恒压模式下电源频率对 ZrH_{1.8} 表面微弧氧化 陶瓷层的影响

王志刚,陈伟东,闫淑芳,范秀娟

(内蒙古工业大学, 内蒙古 呼和浩特 010051)

摘 要: 在磷酸盐体系下,采用恒压模式对氢化锆(ZrH_{1.8})进行微弧氧化。考察了电源频率对氧化膜的厚度、相结构、 截面形貌以及阻氢性能的影响。利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、膜层测厚仪分析了氧化膜的表面形貌、截面 形貌、相结构及膜层厚度。通过真空脱氢实验评估膜层的阻氢性能。结果表明:随着电源频率的增加,ZrH_{1.8}表面微弧 氧化膜层厚度由约50 μm仅减小至约45 μm;电源频率的增加能有效提高膜层的致密性;电源频率的改变对于膜层的相 结构没有明显影响,膜层主要由单斜相氧化锆(M-ZrO₂)和四方相氧化锆(T-ZrO_{1.88})构成,其中单斜相占80%以上;电源 频率的增加有助于提高氧化膜的阻氢效果,当电源频率增加到300 Hz时,氧化膜的氢渗透降低因子PRF值高达10.8。 关键词:氢化锆;微弧氧化;频率;阳氢渗透

中图法分类号: TG174.453

H: TG174.453 文献标识码: A

文章编号: 1002-185X(2015)01-0184-05

氢化锆具有较高的含氢量(H/Zr原子比高达1.8以上)、低的中子捕获截面、负的温度系数、良好的导热性能, 是核反应堆理想的固体中子慢化材料和屏蔽材料^[1-3]。 但是,氢化锆的实际工作温度在650 ℃左右,在此温 度下,氢化锆中的氢原子存在析出的问题,从而导致 慢化效率下降,缩短氢化锆慢化剂的实际使用寿命^[4], 在氢化锆表面制备防氢渗透层显得尤为必要。

目前,防氢渗透层材料主要有碳化物、氧化物、 氮化物及碳化物和氮化物的复合氧化膜材料等^[5-7]。 相关学者通过原位氧化法在氢化锆表面制备氧化锆 防氢渗透层^[8];秦丽娟等人对在氢化锆表面电镀 Cr 制备氢渗透阻挡层进行了研究^[9];赵平等人对氢化锆 表面电镀 Cr-C 制备氢渗透阻挡层进行了研究^[10]。而 对于微弧氧化法在氢化锆表面制备防氢渗透层的研 究甚少。

微弧氧化技术(micro-arc oxidation, MAO)是广 泛应用于 Al、Mg、Ti、Zr 等有色金属及其合金表面 制备氧化膜的一种新技术,利用微弧氧化技术制备的 膜层与基体以冶金方式结合具有较强的结合力,膜层 不易脱落^[11,12]。

本实验采用磷酸盐电解液体系,双向交流脉冲电 源,在恒压模式下对氢化锆进行微弧氧化处理,在基 体表面形成防氢渗透阻挡层。研究电源频率对氢化锆 微弧氧化膜层厚度、组织形貌、相结构及阻氢效果的 影响。为在氢化锆表面用微弧氧化法制备氧化锆防氢 渗透层工艺提供依据。

1 实 验

实验选用材料为ZrH_{1.8},采用数控线切割机将氢化 错线切割成Φ20 mm×2 mm的圆片试样,在距圆片试样 边缘2 mm处打Φ2 mm孔。分别用360#、600#、800# 和1000# SiC水砂纸对试样进行逐级打磨使试样表面 光滑,并将试样的边角打磨圆滑以防止微弧氧化时发 生尖端放电。然后将试样分别置于丙酮及无水乙醇溶 液中进行15 min的超声波去油清洗处理。清洗完毕后 烘干,用于微弧氧化处理。

实验采用去离子水配置电解液,并控制水温在40 ℃ 以下。电解液为Na₅P₃O₁₀+NaOH+Na₂EDTA体系,实验 采用WHD-30 型微弧氧化装置对氢化锆进行微弧氧 化处理。实验过程中电解液温度控制在25 ℃以下,正 向电压、负向电压及电源频率单独可调,实验参数设 置如表1所示。

采用 HCC-25 型电涡流测厚仪对微弧氧化膜进 行膜厚测试;氧化膜物相分析采用荷兰飞利浦 APD-型全自动粉末衍射仪(参数: Cu 靶,电流 35 mA, 电压 40 kV,步进扫描 0.02 °;氧化膜的表面形貌及 截面形貌采用 HITACHI-S3400 扫描电子显微镜进 行观察。

收稿日期: 2014-01-28

基金项目:国家自然科学基金 (51164023);内蒙古自治区高等学校青年科技英才支持计划 (NJYT-13-B10)

作者简介:王志刚,男,1987年生,硕士生,内蒙古工业大学,内蒙古 呼和浩特 010051,电话:0471-6575943, E-mail: zhigang_imut@163.com

表 1 电参数及电解液参数设置

 Table 1
 Settlement of electric and electrolyte parameters

Forward	Negative	Time/	Frequency/	Electrolyte
voltage/V	voltage/V	min	Hz	
430	140	15	100 150 200 250 300	Na5P3O10 NaOH Na2EDTA

采用真空脱氢实验测试氢化锆表面防氢渗透层的 阻氢性能。具体实验方法是将微弧氧化处理后的氢化 锆试样在真空度为 1×10⁻⁴ Pa 真空环境中 650 ℃保温 50 h,然后通过测量试样的失氢量来评价氧化膜的阻 氢效果。氢化锆表面氧化膜的阻氢效果评价按照参考 文献[13],用氢渗透降低因子 PRF(permeation reduction factor)表述。

2 结果与讨论

2.1 电源频率对ZrH_{1.8}表面微弧氧化膜厚度的影响

图1为不同频率下微弧氧化膜层厚度的变化曲线。 从图1中可以看出,随着电源频率的增大,微弧氧化膜 层厚度逐渐减小,随着电源频率从100 Hz增大到300 Hz,膜厚由大约50 μm仅减小到45 μm左右,电源频率 对膜层厚度的影响较小。

由于在保持其它能量参数及电解液参数恒定,只改 变电源频率的情况下,膜层的生长主要取决于单脉冲能 量的大小,而随着电源频率的增加单脉冲能量减小,即 单脉冲脉宽减小,单脉冲持续击穿时间短导致成膜速率 降低。因此,膜层厚度随着电源频率的增加逐渐减小。

2.2 电源频率对ZrH_{1.8}表面微弧氧化膜表面形貌的影响

图2为频率在100和300 Hz下的氧化膜表面形貌。从 图2可以看出,膜层表面比较粗糙而且分布着大小不一 的微孔,这些微小的孔洞是微弧氧化过程中基体与电解 液传递能量及离子的通道^[14]。另外,还有熔化物由微 孔喷出堆积凝固形成的类似火山喷发后残留痕迹。

对比图2b、2c可以看出,随着频率的增加,膜层 的微孔数量增加,而孔径明显减小。频率为100 Hz时 微孔平均直径约3 µm,如图2c所示。当频率增大到300 Hz时,最大微孔直径约1 µm,如图2b的1、2区域所示。 另外,随着频率从100 Hz到300 Hz的增加,类似火山 口的微孔周围堆积物明显减少,整个膜层较平整,表 面粗糙度明显降低。可见,电源频率对膜层表面形貌、 表面粗糙度有很大的影响。

对于产生以上现象的原因主要有以下几个方面: 随着频率的增加,脉宽减小,单位脉冲能量减小,使 得火花放电持续时间减少,从而导致膜层微孔直径减



图 1 电源频率与氧化膜厚度的关系曲线

Fig.1 Relation curve of the frequency vs the oxide film thickness



图 2 不同电源频率下膜层的表面形貌



小。单脉冲能量的减小使熔融的氧化物减少,在电解 液的液淬作用下熔融物快速凝固,导致氧化物膜层表 面熔融物堆积凝固量变少。而对于微孔数量随着频率 的增加而增加,这主要归功于频率的增大使得相同处 理时间内脉冲数量的增加。

2.3 电源频率对ZrH_{1.8}表面微弧氧化膜截面形貌的影响

图3为100和300 Hz下氧化物膜层的截面形貌照 片。从图3a中可以看出,在磷酸盐体系中,恒压模式 下通过微弧氧化在ZrH_{1.8}表面形成连续致密的ZrO₂膜 层。观察图3可以发现,膜层主要由致密层和疏松层两 部分组成,靠近基体部分为致密层,外层为疏松层。 在频率为100 Hz下膜层厚度达50 µm,疏松层大约占总



图 3 不同电源频率下膜层的截面形貌

Fig.3 Cross-sectional morphologies of oxide films under different frequencies: (a) low magnification under 300 Hz, (b) high magnification under 300 Hz, and (c) high magnification under 100 Hz

体膜厚的2/3,而致密层仅为1/3,如图3c所示;当电源 频率为300 Hz时,膜层厚度约为45 μm,膜层总体致密 性较好,而致密层高达总膜层的2/3,如图3b所示。电 源频率的变化对膜层的致密性有很大影响,一定范围 内频率的增加能够提高膜层的致密性。

微弧氧化处理过程中,开始时膜层较薄,容易被 击穿。随着氧化时间的延长,膜层逐渐增厚,膜层被 击穿困难,导致膜层致密性下降,所以致密层靠近基 体,且靠近基体处膜层较外层致密。频率为300 Hz的 膜层致密性明显高于频率为100 Hz的膜层,这是由于 随着电源频率的增加,单位时间膜层被击穿次数增加, 所以膜层的致密性增加。

2.4 电源频率对ZrH_{1.8}表面微弧氧化膜阻氢性能的影响

图4为电源频率从100 Hz到300 Hz增加时对氢渗 透降低因子(PRF)的影响曲线。从图4中可以看出,随 着电源频率的增加, PRF值从8.1增加到10.8。可见, 电源频率对氢化锆表面防氢渗透层阻氢效果有很大的 影响。



图 4 电源频率与氧化膜氢渗透降低因子PRF的关系曲线

Fig.4 Relation curve of the frequency vs the permeation reduction factor of oxide films

结合图1电源频率对膜层厚度的影响知,膜层厚度 随着电源频率增加而减小,随着氧化膜厚度的减小氧 化物膜层的阻氢效果降低,而图4表明,随着电源频率 的增加氧化膜PRF值增加。笔者认为,这可能由于氧 化物膜层的阻氢效果不仅与膜层厚度有关,而且很大 程度上决定于膜层的致密性。结合图3知,随着频率的 增加膜层的致密性增加,因此推断虽然随着频率的增 加膜层厚度降低,削弱了膜层的阻氢效果,但远小于 膜层致密性的增加对膜层阻氢效果的促进作用。

图5为300 Hz下微弧氧化试样经真空脱氢处理后的截面形貌。从图5中可以看出,经真空脱氢后氧化锆 膜层与氢化锆基体仍保持良好结合,膜层结构在真空 脱氢实验前后无明显变化。

2.5 电源频率对ZrH_{1.8}表面微弧氧化膜物相的影响

不同电源频率对ZrH_{1.8}表面微弧氧化膜层物相的 影响如图6所示。从图6中可以看出,膜层主要由单斜 相M-ZrO₂和四方向T-ZrO_{1.88}组成。通过JADE6.5定量分 析^[15],单斜相M-ZrO₂含量较多,占总含量80%以上。



- 图 5 频率为300 Hz下微弧氧化试样真空脱氢实验后的截面形貌
- Fig.5 Cross-sectional morphology of ZrH_{1.8} sample treated by MAO under 300 Hz after the experiment of vacuum dehydrogenation

物相的定量分析结果如表2所示。电源频率的变化对于 氧化锆膜层物相组成的影响并不显著。

M-ZrO₂为低温相,T-ZrO_{1.88}为高温相,从M-ZrO₂ 到T-ZrO_{1.88}的转变温度在1170 ℃左右,而T-ZrO_{1.88}的 存在是因为高温相在电解液类似于"液淬"的骤冷凝固 作用下使高温相保存下来的结果。据文献报道^[16,17], 由于双极性脉冲电源制备的氧化膜较致密,电解液不 易通过放电通道进入氧化膜内部,从而使高温相的冷 却速度降低,所以氧化膜内所形成的熔融氧化物凝固 形成T-ZrO_{1.88}后还会继续转变为M-ZrO₂。



图 6 不同电源频率下氧化膜的XRD图谱

Fig.6 XRD patterns of oxide coatings under different frequencies

表 2 JADE6.5对物相的定量分析结果

Table 2 Quantitative analysis result of phases through JADE6.5

Phase	Content, $\omega/\%$						
	100 Hz	150 Hz	200 Hz	250 Hz	300 Hz		
M-ZrO ₂	98.1	80.8	85.2	82.5	83.6		
T-ZrO _{1.88}	1.9	19.2	14.8	17.5	16.4		

3 结 论

1) 采用磷酸盐电解液体系、双向交流脉冲电源, 在恒压模式下对ZrH_{1.8}进行微弧氧化处理,可在ZrH_{1.8} 基体表面形成致密的ZrO₂防氢渗透阻挡层。

 2)随着电源频率的增加,氧化膜厚度逐渐减小, 膜层致密性增加。随着电源频率从100 Hz增大到300
 Hz,膜厚由大约50 μm仅减小到45 μm左右。

3) 电源频率的改变对于膜层的相结构没有明显 影响。膜层主要由单斜相氧化锆(M-ZrO₂)和四方相 氧化锆(T-ZrO_{1.88})构成。

 4) 恒压模式下,磷酸盐体系电源频率的增加能够 有效地提高氧化膜的阻氢效果,当电源频率增加到300 Hz时,氢渗透降低因子PRF值高达10.8。

参考文献 References

- Konashi K, Ikeshoji T, Kawazoe Y et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2003, 356-357: 279
- [2] Puls M P, Shi S Q, Rabier J. Journal of Nuclear Materials[J], 2005, 336(1): 73
- [3] Kim Y S, Wang W E, Olander D R et al. Journal of Nuclear Materials[J], 1997, 246(1): 43
- [4] Chen W D, Wang L J, Lu S G. Journal of Alloys and Compounds[J], 2009, 469(1-2): 142
- [5] Li Qingsheng(刘庆生), Qin Lijuan(秦丽娟), Zhao Ping(赵平) et al. Surface Technology(表面技术)[J], 2005, 34(2): 334
- [6] Chen Weidong(陈伟东), Han Lin(韩琳), Zhang Li(张力) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与 工程)[J], 2007, 36(10): 1848
- [7] McGuiness P J, Čekada M, Nemanič V et al. Surface and Coatings Technology[J], 2011, 205(8-9): 2709
- [8] Chen Weidong(陈伟东), Wang Lijun (王力军), Wang Jianwei (王建伟) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金 属材料与工程)[J], 2008, 37(11): 1970
- [9] Qin Lijuan(秦丽娟), Zhao Ping(赵平). Development and Application of Materials(材料开发与应用)[J], 2005, 20(3): 25
- [10] Zhao Ping(赵平), Kong Xianggong(孔祥巩), Zou Congpei (邹从沛). Nuclear Power Engineering(核动力工程)[J], 2005, 26(6): 576
- [11] Zhong Taosheng(钟涛生), Jiang Bailing(蒋百灵), Li Junming (李均明). *Electroplating and Finishing*(电镀与涂饰)[J], 2005, 24(6): 47
- [12]Wang Rongli(王蓉莉), Li Wei(李 卫), Luo Jianye(罗健业). Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2011, 40(6): 1110
- [13] Zhong Xuekui(钟学奎), Yan Guoqing(闫国庆), Chen Weidong (陈伟东) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有 金属材料与工程)[J], 2012, 41(S2): 541
- [14] Xu Jilin(徐吉林), Liu Fu(刘 福), Luo Junming(罗军明) et al.
 Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2012, 41(10): 1770
- [15] Fan X Z, Wang Y, Zou B L et al. Applied Surface Science[J], 2013, 277: 272
- [16] Xue Wenbin(薛文斌), Jin Qian(金 乾). Transactions of Materials and Heat Treatment(材料热处理学报)[J], 2010, 31(2): 119
- [17] Wang Fengbiao(王凤彪), Di Shichun(狄士春). Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2012, 41(2): 298

Effect of Frequency on MAO Film on the Surface of ZrH_{1.8} under Constant-Voltage Mode

Wang Zhigang, Chen Weidong, Yan Shufang, Fan Xiujuan (Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051, China)

Abstract: Micro-arc oxidation (MAO) process was conducted on $ZrH_{1.8}$ in an electrolyte composed of $Na_5P_3O_{10}$ under the constant voltage mode. The influence of frequency on thickness, phase structure, cross-section morphology and the hydrogen resistance performance of coatings were investigated. The surface and cross-sectional morphologies, phase structure of the coatings and film thickness were characterized by scanning election microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). Hydrogen resistance performance was evaluated by vacuum dehydrogenation. The results show that the thickness of coatings on $ZrH_{1.8}$ decreases from about 50 µm to 45 µm with the increase of frequency. The increase of frequency can enhance the density of coating effectively. Besides, the change of frequency has no obvious influence on the coating phase structure, and the coating is mainly composed of M-ZrO₂ and T-ZrO_{1.88}, and the amount of M-ZrO₂ accounts for more than 80%. The increase of frequency can improve the hydrogen resistance of the ceramic coating, and the PRF (permeation reduction factor) value reaches up to 10.8 when the frequency increases to 300 Hz.

Key words: zirconium hydride; micro-arc oxidation; frequency; hydrogen resistance performance

Corresponding author: Chen Weidong, Ph. D., Inner Mongolia University of Technology, Hohhot 010051, P. R. China, Tel: 0086-471-6575943, E-mail: weidongch@163.com